DERWENT-ACC-NO:

1988-165793

DERWENT-WEEK:

198824

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

Polymeric moulding, with improved adhesion to adhesive or paint - by roughening surface of polymeric material

e.g. polyacetal with laser

PATENT-ASSIGNEE: TOYODA GOSEI KK[TOZA]

PRIORITY-DATA: 1986JP-0251095 (October 21, 1986)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE May 10, 1988 LANGUAGE

**PAGES** 

MAIN-IPC

JP 63105042 A

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

004

N/A

APPLICATION-DATA: PUB-NO

JP 63105042A N/A

1986JP-0251095

APPL-DATE

INT-CL (IPC): B29C059/16,

B29C065/52 ,

B29C071/04 , C08J007/00

N/A

Oct 21, 1986

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63105042A

BASIC-ABSTRACT:

Polymeric moulding comprises roughening the surface of polymeric material with laser.

Pref. as the laser, CO2- and YAG-laser can be used. As the polymeric material, polyacetal, glass fibre reinforced plastics and polyolefin are used. Also polyamide, polycarbonate, ABS resin, polybutylene terephthalate, natural rubber, synthetic rubber (butadiene- or isoprene-type rubber), polyalkylene sulphide, ethylene-propylene type rubber, alkyl siloxane condensate, vinylidene fluoride-hexafluoropropylen e copolymer, polyesterisocyanate condensate, acrylic acid ester-crosslinking comonomer copolymer, etc. are used. USE/ADVANTAGE - Polymeric moulding shows improved close sticking property by anchoring effect when adhesive or paint is coated on the surface and roughening of the surface can be carried out opt. with pref. position and shape easily, freely and accurately. Also cost can be saved and working time can be reduced by making laser irradiation automatically. CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/4

TITLE-TERMS: POLYMERISE MOULD IMPROVE ADHESIVE ADHESIVE PAINT ROUGH SURFACE POLYMERISE MATERIAL POLYACETAL LASER

ADDL-INDEXING-TERMS:

POLYAMIDE POLYCARBONATE POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE POLYOLEFIN

DERWENT-CLASS: A35

CPI-CODES: A11-C04E;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 5214U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0009 0011 0016 0210 0229 0232 3151 0241 3153 0250 0307 3161 0377 0494 0495 0496 0845 3169 0963 1093 1096 1100 1275 1280 1283 3179 1292 1296 1306 1323 1403 1462 1511 1758 1913 1987 2020 2196 2214 2478 2545 3252 2661 2682 2726 Multipunch Codes: 014 03- 032 034 041 046 047 05- 050 055 056 062 064 071 072 074 076 080 081 089 117 122 123 138 141 143 144 148 150 151 155 156 157 158 163 166 169 170 173 180 209 225 229 231 239 257 27& 28& 308 309 38- 441 443 466 467 473 476 477 54& 546 575 58& 597 600 602 609 681 688 723 SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers:

C1988-074085

子材料裏面の粗面化が思い通りの位置、形状で容 器に、自由にしかも正確にできる。

#### (実施例)

以下に本発明を具体化した実施例を第1図~第4図を用いて説明する。

一般にレーザーは境幅倍率によって気体レーザー、液体レーザー、固体レーザーの3種類に分けられ、以下の実施例で用いるCO。レーザーは気体レーザーに属し、YAGレーザーは固体レーザーに属するものである。

またレーザーを用いて金属加工する場合、一般に単位面積あたりに照射するレーザーのパワー密度によって切断、溶接、アニーリングの加工法に分類されるが、以下の実施例においては切断と溶接の中間パワー密度を用いることにより、高分子材料表面の粗面化ができる。

#### 実施例1

本実施例ではポリアセタール(以下POMという)、ガラス繊維強化プラスチック(以下FRPという)又はポリプロピレン(以下PPという)

表一1

			·			
No	材質	出力 (W)	加工 スピード (mm/s)	D f	ピッチ (mm)	外観
. 1	POM	1 5	1 0 0	- 25	1	粗面化
2	FRP	3 0	1 0 0	- 25	1	粗面化
3	FRP	2 5	100	- 25	ı	粗面化
4	FRP	2 5	100	- 25	0.5	粗面化
5	PP	1 5	1 0 0	- 25	1	粗面化

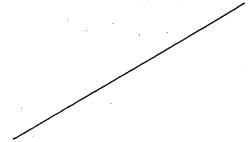
本実施例で得られた高分子成形品の表面についてみると、第1図に示すように高分子材料1としてのPOM、FRP又はPPの表面1aはCO:

の表面にCOェレーザーを照射した。

次にPOMの製団を粗面化するのに使用したCOェレーザー照射装置について説明すると、第3 図に示すようにCOェレーザー発生機14で発生したレーザーは集光レンズ9により被加工物11に集光される。レーザービームのスポット径は通常20μαで、この焦点をポカして(デフォーカス)スポット径0.5 mm又は1 mmで行った。上記COェレーザー照射装置を用い、次の裏-1に示す加工条件に基づいて高分子材料製団の粗面化を行った。

レーザー照射後の樹脂表面の状態についても表 - 1 に併記した。

なお、CO。レーザーは、その性質から光ファイバーを使用することができない。



レーザーによって粗面化されている。そして上記高分子材料1の表面1 a は第2 図に示すように山部1 b と谷部1 c とが明瞭に認められる。また C O ェレーザー照射のピッチが0.5mm の場合は、1 mmの場合に比べて高分子材料1の表面がより平滑になる。

CO \* レーザーによる樹脂表面の粗面化は後述するYAGレーザーによる樹脂表面の粗面化に比べて低い出力で行うことができ、同出力の場合はより広い面積を高速で粗面化することができる。即ち、CO \* レーザーの波長は10.6 μα 、YAGレーザーの波長は1.06 μα であり、樹脂の吸収帯と比較するとCO \* レーザーが樹脂加工には通切である。

#### 実施例 2

本実施例では、間体レーザーとしてのYAGレーザーを用いてFRP、PP又はPOMの表面の加工処理を行った。

次に上記高分子材料の表面を粗面化するのに使用したYAGレーザー照射装置について説明する

#### 特開昭63-105042(3)

と、第4図に示すようにYAGレーザー発生機 2 はレーザーロッド 3 、ランプ 4 、レーザーの増幅 作用をするミラー 5 、塩源 6 及びYAGレーザー 発生機 2 を冷却する冷却水ポンプ 7 から構成され ている。

YAGレーザー発生機2で発生したレーザーは 光ファイバーケーブル8を経由し、集光レンズ9 により架台10上の被加工物11に集光される。 その際被加工物11にレーザーが集光される付近 には窒素供給配管12を通って窒霜ガスが吹きつ けられる。

また光ファイバーケーブル8はロボット13に よって自由自在に被加工物11に対するレーザー の照射位置を調節できる。

なお、YAGレーザービームのスポット径はデフォーカスしても lea程度が限度である。

上記YAGレーザー発生機を用い、次のような 順序で高分子材料表面にYAGレーザーを照射した。

まず、被加工物11である高分子材料を架台1-

そして、YAGレーザー発生機2が駆動され、 レーザーが発生し、それが光ファイバーケーブル 8に再かれ、集光レンズ9で集光されて、ロボッ トの操作で被加工物11の表面上に照射され、レ

0上に敬せる。次いで被加工物 1 1 上に描きたい

模様に沿ってレーザーが照射されるようにロボッ

- ザー加工が行われる。

ト13を設定する。

YACレーザーのエネルギーは高密度であるので、被加工物であるPOMの表面を特度よく確実に加工できる。

なお、POM裏面の処理面積を大きくする場合は、デフォーカスして単位面積当たりのパツー密度を小さくして実施することができる。また、YAGレーザーは光ファイバーを用いて任意の位置で照射することができるので前記CO。レーザーに比較して作業がしやすいという利点がある。

YAGレーザーによる具体的な加工条件及び Y AGレーザー照射後の樹脂表面の状態は表 - 2 の 通りである。

表 - 2

N	- 1	材質	出力 ·(W)	加工 スピード (mm/s)	SCAN 回数 (回)	Q-Swit ch周彼 数 KHz	外観
-	;	FRP	4 0	1 0 0	500	1	相面化
7	,	pр	4 0	1 0 0	500	1	粗面化
	3	POM	4 0	1 0 0	500	1	点状

上記のようにYAGレーザーを用いることにより、 帯脂表面の粗面化をはかることができ、 得られた 帯脂の裏面は、前記実施例1と同様第1図に示すように高分子材料1としてのFRP、PP又はPOMの表面1aはYAGレーザーによって粗面化され、 段差がついている。 そして高分子材料1の表面1aは、第2図に示すように、山部1b

と谷郎1cとが明瞭に認られる。

上記のいずれの実施例においても高分子材料の 表面は、境い目(見切り線)が鮮明であり、しか もレーザー加工の自動化が簡単でコストも安く、 加工時間も大幅に節約できる。

さらに、FRP、PP又はPOMの表面に飲料や接着剤を堕布した場合、表面の粗面化に基づくアンカー効果によって密着性が非常に良好となる。

本発明の高分子成形品は自動車の部品、例えば パンパー、ラジエーターグリル、モール、インス トルメントパネル、エンプレム、電化製品のケース、 ダえば洗濯機のケース、冷蔵庫のケース、テ レビのケース、その他あらゆる製品に利用される。

本発明は上記実施例に限定されず、次のように 構成することもできる。

(1) 高分子材料(1) は、上記実施例では樹脂としてPOM、FRP及びPPを用いたが、それ以外にポリアミド、ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート(PBT)を用いることもでき、またゴムとして天然ゴム、合成

### 特開昭63-105042(4)

ゴムも使用することができる。

合成ゴムとしては、ブタジエン系ゴム、イソプレン系ゴム等のジエン系ゴム、ポリアルキレン・スレン・プロシロ・サン系ゴムを動物をある。 ルフィド等の多硫化物系ゴム、エチレン・プロ・シロ・サン系ゴム等のオレフィン系ゴム、アルキル・ア・アル・カー・サンフロライドーへまれたのプロピレンルである。 ないシアネート縮合物等のカレタン系ゴム、アル・タリル酸エステル・架橋コモノマー共産合物等のピニル系ゴム等があげられる。

(2) レーザーは、上配実施例では気体レーザーの1種であるCO。レーザー、固体レーザーの1種であるYAGレーザーを用いたが、それ以外の種類の気体レーザー又は固体レーザー、さらに液体レーザーも用いることができる。

#### 発明の効果

本発明の高分子成形品は、その表面に接着剤や 塗料を塗布した場合、アンカー効果により密着性 が格段に向上し、かつ表面の粗面化が思い通りの― 位置、形状で容易に、自由にしかも正確にできる という優れた効果を奏する。

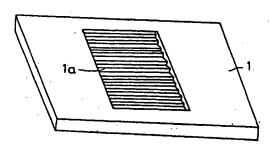
さらに、レーザー照射の自動化が簡単にでき、 作業時間の短縮及びコストの節約ができる。 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の粗面化された高分子成形品の 裏面を示す斜視図、第2図は同じく本発明の高分子成形品の 実成形品の裏面の拡大断面関、第3図はCO2レ ーザー照射装置を示す模式図、第4図はYACレ ーザーの発生及び照射機構を示す模式図である。

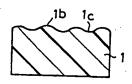
#### 1 … 高分子材料

特許出願人 费田合成株式会社 代理人 弁理士 恩田博寶

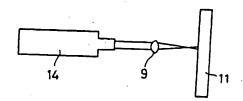
### 第 1 図



# 第2図



# 第3図



# 第 4 図

